瑞士 SAWATEC · SM 系列

SM-200 实验室晶圆旋涂仪

中文选型资料 / 半自动匀胶机 · 光刻胶薄膜旋涂



SAWATEC SM-200 是用于实验室与工艺研发的半自动晶圆旋涂设备，英文原厂名称为 Spin Module SM-200。通过旋转基板涂覆光刻胶，采用人工上下片。

适合需求：最大 200 mm 晶圆的光刻胶旋涂、可编程工艺开发及重复批次涂覆。供液、去边与背洗等选件应按材料和目标工艺逐项确认。

型号与配置核对

品牌 / 完整型号	瑞士 SAWATEC / SM-200
最大圆片直径	200 mm（8 英寸）
最大方形基板	150 × 150 mm
上下片 / 固定	人工上下片 / 真空固定与保护
腔体与点胶	RCCT 封闭腔；动态点胶臂，最多四条介质管路
安装形式	实验台安装式或移动柜式；按具体配置确认

尺寸边界：200 × 200 mm 方片不属于 SM-200 的上述基板上限。旋涂后烘胶是另一道工序；不能由半自动旋涂或同柜组合推定腔内基板加热。

可核验出处与在线型号页

原厂：SM-200 型号、旋涂用途、基板及配置规格
https://sawatec.com/en/products/#panel-2282

上海交通大学：SM-200 半自动涂胶机及光刻胶旋涂用途
https://aemd.sjtu.edu.cn/platform/831.html

中国官网：SAWATEC SM-200 中文型号页
https://sawatec.com.cn/sm-200-spin-coater

依据原厂公开规格与既有校方设备记录整理；校方配置用于核对用途，不代表所有选件均为标准配置。最终采购技术规格以确认的型号与配置为准。